

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】令和 1 年 11 月 14 日 (2019.11.14)

【公開番号】特開 2019-148825 (P2019-148825A)

【公開日】令和 1 年 9 月 5 日 (2019.9.5)

【年通号数】公開・登録公報 2019-036

【出願番号】特願 2019-92552 (P2019-92552)

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

G 0 3 F 9/00 (2006.01)

【F I】

G 0 3 F 7/20 5 0 5

G 0 3 F 9/00 A

【手続補正書】

【提出日】令和 1 年 10 月 1 日 (2019.10.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 6 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 6 4】

なお、一例として、各描画ライン S L 1 ~ S L 6 の実効的な長さ（描画長）を 3 0 m m とし、実効的なサイズ が $3 \mu\text{m}$ のスポット光 S P の $1/2$ ずつ、つまり、 $1.5 (= 3 \times 1/2) \mu\text{m}$ ずつ、オーバーラップさせながらスポット光 S P を描画ライン S L n (S L 1 ~ S L 6) に沿って基板 P の被照射面上に照射する場合、パルス状のスポット光 S P は、 $1.5 \mu\text{m}$ の間隔で照射される。したがって、1 回の走査で照射されるスポット光 S P の数は、 $20000 (= 30 [\text{mm}] / 1.5 [\mu\text{m}])$ となる。また、基板 P の副走査方向の送り速度（搬送速度）V t を 2.42 mm / sec とし、副走査方向についてもスポット光 S P の走査が $1.5 \mu\text{m}$ の間隔で行われるものとする、描画ライン S L n に沿った 1 回の走査開始（描画開始）時点と次の走査開始時点との時間差（周期）T p x は、 $\text{約 } 620 \mu\text{sec} (= 1.5 [\mu\text{m}] / 2.42 [\text{mm / sec}])$ となる。この時間差 T p x は、8 反射面 R P のポリゴンミラー P M が 1 面分（ $45 \text{ 度} = 360 \text{ 度} / 8$ ）だけ回転する時間である。この場合、ポリゴンミラー P M の 1 回転の時間が、 $\text{約 } 4.96 \text{ msec} (= 8 \times 620 [\mu\text{sec}])$ となるように設定される必要がある、ポリゴンミラー P M の回転速度 V p は、毎秒約 $201.613 \text{ 回転} (= 1 / 4.96 [\text{msec}])$ 、すなわち、 $\text{約 } 12096.8 \text{ rpm}$ に設定される。